

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成 19 年 11 月 8 日 (2007.11.8)

【公表番号】特表 2003-511799 (P2003-511799A)
 【公表日】平成 15 年 3 月 25 日 (2003.3.25)
 【出願番号】特願 2001-530810 (P2001-530810)
 【国際特許分類】

G 0 6 F 3/044 (2006.01)

G 0 6 F 3/041 (2006.01)

G 0 6 T 1/00 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 3/03 3 3 5 E

G 0 6 F 3/033 3 6 0 D

G 0 6 T 1/00 4 0 0 G

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 8 月 29 日 (2007.8.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 X 軸に沿って設置された複数の実質的に透明な伝導トレースおよび Y 軸に沿って設置された複数の実質的に透明な伝導トレースを含み、伝導物体からの入力を受け入れるように構成された活動領域、および

前記伝導トレースの間に介在する実質的に透明な接着剤、を含み、

前記活動領域内で実質的に均一な透明度を有する実質的に透明な容量センサシステム。

【請求項 2】 基板、

第 1 の軸に沿って設置された複数の実質的に透明な伝導トレースを含み、前記基板の一部を覆い、前記基板上に設置されセンサアレイであり、第 2 の軸に沿って入力物体を容量的に検出するように構成されたセンサアレイ、

前記入力物体とは反対側の前記センサアレイの底部を電氣的にシールドする様に構成された実質的に透明な且つ導電性の接地面、および

前記センサアレイの容量変化を検出するための検出装置を含む、透明な容量接触検出システム。

【請求項 3】 X 軸に沿った複数の伝導トレースおよび Y 軸に沿った複数の伝導トレースを含む 2 次元センサアレイであり、2 つの軸に沿って、入力物体と前記センサアレイとの間の容量性結合を検出するように適合された 2 次元センサアレイ、および

前記センサアレイにおける容量変化を検出するための検出装置とを含み、

X 軸に沿った前記複数の伝導トレースの各々の間に複数のスペースが形成されるように、X 軸に沿った前記複数の伝導トレースは、X 軸に沿って第 1 の距離離されて、分離されており、

Y 軸に沿った前記複数の伝導トレースは、Y 軸に沿って第 2 の距離離されて、分離されており、Y 軸に沿った前記複数の伝導トレースが、X 軸に沿った前記複数の伝導トレースを、X 軸および Y 軸に直交して見た場合に、Y 軸に沿った前記複数の伝導トレースが前記複数のスペースを充填するように、補完しており、

X 軸及び Y 軸に沿った前記複数の伝導トレースが透明であり、

透明且つ電氣的に絶縁材料が、X 軸に沿った前記複数の伝導トレースを Y 軸に沿った

前記複数の伝導トレースを分離する、透明な容量接触検出システム。

【請求項 4】 入力物体と反対側の前記センサアレイの底部を電氣的にシールドするように構成された実質的に透明且つ電氣的伝導接地面を更に含む請求項 3 記載のシステム。

【請求項 5】 前記センサアレイが、ほぼ同じ反射係数を有する複数の層を含む請求項 3 又は 4 記載のシステム。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 の何れかに記載のシステムが上部に直接設置されている表示装置。